

Распределение потенциала и концентрации электронов в слое полупроводника между двумя одинаковыми металлическими электродами с обогащенными слоями схематически показано на рис. 6.10.

Таким образом, прилегающие к металлическим электродам слои полупроводника, толщина которых  $\sim a$ , могут «заливаться» носителями заряда. При этом концентрация носителей вблизи контактов, как показывает формула (8.4), не зависит от их концентрации в глубине полупроводника  $n_0$ , которая может быть как угодно мала (изолятор). Поэтому электропроводность слоистых (пленочных) структур металл — тонкий слой диэлектрика — металл (структура МДМ) может быть велика, даже если удельная электропроводность диэлектрика (в отсутствие контакта) ничтожно мала.

### § 9. Истощенный контактный слой

Рассмотрим теперь противоположный случай, когда приконтактный слой в полупроводнике обеднен основными носителями (запорный, или блокирующий, контакт). Мы ограничимся предельным случаем очень сильного обеднения, который особенно легко поддается расчету и в то же время часто встречается в практике.

*Контакт металл—полупроводник.* Положим, что к контакту приложено внешнее напряжение  $u$ , создающее обедненный слой. Если напряжение достаточно велико, то, следуя Шоттки, можно приближенно считать, что в некотором слое полупроводника толщиной  $d$  электронов нет вовсе («полностью истощенный слой»), так что объемный заряд обусловлен только заряженными донорами и акцепторами. В этом случае имеем  $eu_k > 0$  (запорный слой),  $\exp \frac{e(\varphi - u_k)}{kT} \ll 1$  и уравнение Пуассона (6.11) принимает простой вид:

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -\frac{4\pi en_0}{\varepsilon} = \text{const.} \quad (9.1)$$

Интегрируя это уравнение два раза и принимая во внимание граничные условия (при  $d$ , подлежащем определению):

$$x=0: \quad \varphi=0; \quad x=d: \quad \varphi=u+u_k, \quad \frac{d\varphi}{dx}=0, \quad (9.2)$$

мы получаем

$$-\frac{d\varphi}{dx} = \mathcal{E} = -\frac{4\pi en_0}{\varepsilon} (d-x), \quad (9.3)$$

$$\varphi = u_k + u - \frac{2\pi en_0}{\varepsilon} (d-x)^2. \quad (9.4)$$

Полагая в формуле (9.4)  $\varphi = 0$ ,  $x = 0$ , находим толщину запорного слоя:

$$d = \sqrt{\frac{\varepsilon(u_k + u)}{2\pi en_0}}. \quad (9.5)$$

Аналогично можно найти распределение электрического поля и потенциала в контакте двух полупроводников. При этом особый интерес представляет случай, когда один из полупроводников имеет проводимость  $p$ -типа, а другой —  $n$ -типа. Такие электронно-дырочные переходы, или, иначе,  $p$ — $n$ -переходы, широко применяются в современной полупроводниковой электронике (см. гл. VII и VIII). Для получения истощенных слоев, очевидно, необходимо, чтобы к  $n$ -части перехода был приложен плюс источника, а к  $p$ -части — минус (рис. 6.11, а), или, при обратной полярности,  $|u| < |u_k|$ .

Толщина заборных слоев  $d_p$  и  $d_n$  в обеих частях перехода и распределение потенциала в них зависят от закона распределения доноров и акцепторов. Мы рассмотрим два практически важных случая.

**Резкий  $p$ — $n$ -переход.** Разность концентраций доноров  $N_d$  и акцепторов  $N_a$  постоянна в каждой области перехода и скачком меняется в плоскости контакта. Доноры и акцепторы будем считать полностью ионизованными. Тогда концентрации электронов и дырок вдали от контакта, где нет объемного заряда, равны:

$$\begin{aligned} n_0 &\simeq N_d - N_a & (x > d_n), \\ p_0 &\simeq N_a - N_d & (x < -d_p). \end{aligned}$$

Поэтому для объемного заряда в приконтактных слоях мы имеем:

$$\begin{aligned} p\text{-область: } \rho &= \begin{cases} -e\rho_0 & (-d_p < x < 0), \\ 0 & (x < -d_p); \end{cases} \\ n\text{-область: } \rho &= \begin{cases} e n_0 & (0 < x < d_n), \\ 0 & (x > d_n). \end{cases} \end{aligned} \quad (9.6)$$

Это распределение  $\rho(x)$  изображено на рис. 6.11, б.

Будем отсчитывать, как и раньше, потенциал от его значения в плоскости  $x = 0$ . Тогда граничные условия задачи имеют вид:

$$\begin{aligned} x = -d_p: \quad \varphi &= u_p, & \frac{d\varphi}{dx} &= 0; \\ x = d_n: \quad \varphi &= u_n, & \frac{d\varphi}{dx} &= 0, \end{aligned} \quad (9.7)$$

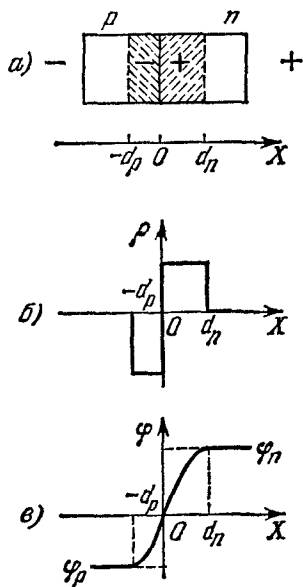


Рис. 6.11. Резкий  $p$ — $n$ -переход при обратном смещении. Распределение объемного заряда  $\rho$  и потенциала  $\varphi$ .

где  $u_p$  и  $u_n$  — падения напряжения на слоях объемного заряда в  $p$ - и, соответственно, в  $n$ -области. Подставляя выражения (9.6) для  $\rho$  в уравнение Пуассона и интегрируя последнее при учете (9.7), получаем:

$$\begin{aligned} p\text{-область: } \varphi_p &= u_p + \frac{2\pi e p_0}{\varepsilon} (x + d_p)^2, \\ n\text{-область: } \varphi_n &= u_n - \frac{2\pi e n_0}{\varepsilon} (x - d_n)^2. \end{aligned} \quad (9.8)$$

Потенциал в слоях объемного заряда изменяется по параболическому закону, изображенному на рис. 6.11, в. При  $x = 0$  оба выражения (9.8) должны давать одно и то же значение потенциала в плоскости контакта. Отсюда

$$u_n - u_p = \frac{2\pi e}{\varepsilon} (n_0 d_n^2 + p_0 d_p^2), \quad (9.9)$$

где

$$u_n - u_p = u + u_k$$

есть полное напряжение на переходе, складывающееся из контактной разности потенциалов  $u_k$  и напряжения источника  $u$ .

Так как электрическая индукция  $e \mathcal{E}$  должна быть везде непрерывна (а диэлектрическую проницаемость  $\varepsilon$  мы считаем одинаковой в  $p$ - и  $n$ -областях), то

$$\mathcal{E}_p(0) = -\frac{d\varphi_p}{dx} \Big|_{x=0} = \mathcal{E}_n(0) = -\frac{d\varphi_n}{dx} \Big|_{x=0}.$$

Это дает

$$n_0 d_n = p_0 d_p. \quad (9.10)$$

Соотношения (9.9) и (9.10) позволяют найти толщины слоев объемного заряда  $d_n$  и  $d_p$ .

Полагая в формулах (9.8)  $x = 0$  и, соответственно,  $\varphi_p = \varphi_n = 0$  и учитывая (9.10), находим, что падения напряжений в  $p$ - и  $n$ -областях относятся, как

$$\left| \frac{u_p}{u_n} \right| = \frac{n_0}{p_0}.$$

Поэтому, если, например,  $p_0 \gg n_0$ , то будем иметь  $d_p \ll d_n$  и, кроме того, все приложенное напряжение будет сосредоточено в  $n$ -области. Если, напротив,  $n_0 \gg p_0$ , то все падение напряжения будет сосредоточено в  $p$ -области и при этом будет  $d_p \gg d_n$ .

При произвольных концентрациях  $n_0$  и  $p_0$  из формул (9.9) и (9.10) легко получить, что полная толщина слоя объемного заряда равна

$$d = d_n + d_p = \left( \frac{\varepsilon (u + u_k)}{2\pi e} \frac{p_0 + n_0}{p_0 n_0} \right)^{1/2}. \quad (9.11)$$

Если  $n_0 \ll p_0$ , то

$$d \simeq d_n = \left( \frac{\varepsilon (u + u_k)}{2\pi e n_0} \right)^{1/2}, \quad (9.11')$$

что совпадает с формулой (9.5) для контакта металл—электронный полупроводник. При  $p_0 \ll n_0$  в формулу (9.11') вместо  $n_0$  входит  $p_0$ .

*Плавный p—n-переход.* Если разность  $(N_d - N_a)$  изменяется в пространстве непрерывно, то распределения поля и потенциала будут другими и будут зависеть от закона изменения  $(N_d - N_a)$ . Рассмотрим простейший случай, когда на протяжении слоя объемного заряда (толщина которого определяется формулой (9.15)) этот закон можно считать линейным:

$$N_d - N_a = ax,$$

где  $a$  — постоянная. Тогда распределение объемного заряда будет (рис. 6.12)

$$\rho = eax. \quad (9.12)$$

При этом из симметрии задачи очевидно, что падения напряжения на каждом из слоев одинаковы и равны половине полного напряжения  $(u + u_k)$ . Тогда, подставляя (9.12) в уравнение Пуассона и учитывая граничные условия:

$$x = 0: \quad \varphi = 0; \quad x = \pm 1/2 d: \quad \frac{d\varphi}{dx} = 0, \quad (9.13)$$

находим

$$\varphi = \frac{2\pi a e}{\varepsilon} (1/4 d^2 x - 1/3 x^3). \quad (9.14)$$

В этом случае потенциал изменяется по кубическому закону. Полагая в формуле (9.14)  $x = d/2$  и, соответственно,  $\varphi = (u + u_k)/2$ , получаем для толщины двойного слоя объемного заряда

$$d = \left[ \frac{3\varepsilon (u + u_k)}{\pi e a} \right]^{1/3}. \quad (9.15)$$

Поступая аналогично, можно найти толщину слоя объемного заряда и для других законов распределения  $(N_d - N_a)$ .

*Зарядная емкость.* Толщина слоя объемного заряда возрастает с увеличением приложенного обратного напряжения, и при этом растет и полная величина заряда, сосредоточенного в слое. Отсюда следует, что контакт обладает определенной емкостью. Она получила название *зарядной емкости*.

Рассмотрим в качестве примера резкий p—n-переход с сильно легированной p-областью (или контакт металл—полупроводник n-типа). Тогда величина заряда в слое, рассчитанная на единицу поверхности, есть

$$q = e n_0 d_n.$$

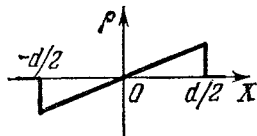


Рис. 6.12. Плавный p—n-переход при обратном смещении. Распределение объемного заряда.

Подставляя сюда для  $d_n$  выражение (9.11'), находим для зарядной емкости

$$C = \frac{dq}{du} = \left( \frac{\varepsilon \varepsilon n_0}{8\pi (u + u_k)} \right)^{1/2} = \frac{\varepsilon}{4\pi d_n}. \quad (9.16)$$

Это выражение совпадает с формулой для емкости плоского конденсатора с толщиной зазора между обкладками, равной  $d_n$ .

Оценим порядок величины этой емкости. Рассмотрим германий ( $\varepsilon = 16$ ) с концентрацией электронов  $n_0 = 1 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$  и положим, что  $u + u_k = 1 \text{ В} = (1/300) \text{ ед. СГСЭ}$ . Тогда из (9.11') имеем  $d_n \simeq 4 \cdot 10^{-4} \text{ см} = 4 \text{ мкм}$  и (9.16) дает  $C \simeq 10^4/\pi \text{ см/см}^2$ , или  $\sim 10^3 \text{ пФ/см}^2$ .

Для плавного перехода с линейным распределением доноров и акцепторов имеем

$$q = ea \int_0^{d/2} x dx = \frac{1}{8} ead^2.$$

Подставляя сюда для  $d$  выражение (9.15) и дифференцируя по  $u$ , находим для емкости (опять на единицу поверхности)

$$C = \frac{\varepsilon}{4\pi} \left[ \frac{\pi ea}{3\varepsilon (u + u_k)} \right]^{1/3} = \frac{\varepsilon}{4\pi d}. \quad (9.17)$$

Из выражений (9.16) и (9.17) видно, что зарядная емкость зависит от приложенного обратного напряжения, и притом различно при различных законах распределения примесей. Для резкого перехода  $C \sim u^{-1/2}$ , для линейного закона распределения  $C \sim u^{-1/3}$ , а при другом законе распределения эта зависимость была бы иная. Поэтому, исследуя на опыте зависимость  $C$  от  $u$ , можно сделать выводы о структуре  $p$ - $n$ -перехода, т. е. о законе распределения примесей в нем.

## § 10. Токи, ограниченные пространственным зарядом

Обратимся теперь к зависимости тока сквозь контакт от приложенного внешнего напряжения. Вольтамперные характеристики контактов оказываются различными в зависимости от того, имеем ли мы контакты с обогащенным слоем или с обедненным слоем.

Рассмотрим сначала случай обогащенного слоя.

Энергетическая диаграмма такого контакта изображена на рис. 6.13. В отсутствие внешнего напряжения потенциальная энергия электрона  $-e\varphi$  в области объемного заряда вблизи металлического электрода увеличивается при удалении от электрода по логарифмическому закону (8.2). За областью объемного заряда она постоянна. Поэтому энергия дна зоны проводимости  $E_c$ , которая изменяется так же, как и  $-e\varphi$ , изображается кривой 1. В области объемного заряда имеются ток диффузии и ток дрейфа, которые на-